CH4.Imperfections

Vacancy

$$N_v = N \exp\left(-\frac{Q_v}{kT}\right)$$

k is 1.38×10^{-23} J/atom-K 計算常換 eV

對金屬而言,剛低於熔點的空位分率,約 10^{-4} (一萬個原子才可能有一個 vacancy) 形成的能量大概是 $\underline{1eV}$

是由於晶體成長的局部擾動所造成的,或是 atomic mobility 造成的原子重新排列 引入額外的空位的方法→塑性變型、高溫極速冷卻、高能量粒子碰撞,非平衡的 空位常會有 cluster 的現象→divacancy、trivacancy

空位的移動→與鄰近原子位置的互換

self-interstitial(interstitialcy)

置換原子會引起畸變,可能性較 vacancy 低很多! 一般不會自然產生,但可用照射或輻射的方式產生!

陶瓷中缺陷(離子晶體的缺陷)→會增加導電率!!

Frenkel defect→陽離子空位&陽離子間隙(陽離子亂跑)
Schottky defect→陽離子空位&陰離子空位(陰陽一起跑掉)
(陰離子太大,比較不會 Frenkel!)

$$N_{fr} = N \exp\left(-\frac{Q_{fr}}{2kT}\right) \quad N_s = N \exp\left(-\frac{Q_s}{2kT}\right)$$

雜質

即使存度高達 99.9999%,一立方米還是會有 $\underline{10^{22}}$ 到 $\underline{10^{23}}$ 的雜質原子 將雜質加入金屬,形成 soloid solution,溶劑原子 solvent atoms,有時候稱為 host atoms

只有少數金屬會應用在高純度

EX.高純度銅(99.99%AI)→非常高導電率 高純度鋁(99.99%Cu)→光亮金屬表面→美觀 大多數都是金屬和其他金屬或非金屬合成→合金

EX.彈殼黃銅 70wt%銅 30wt%鋅

合金最簡單的形式是固溶體

固溶體→不同元素 dispersed in a single phase structure

置換型和間隙型

置換型的 factor → Hume-Rothery rules

- 1.尺寸→直徑正負 15%
- 2.晶體結構一樣
- 3.電負度差,太高會傾向於形成 intermetallic compound

4.valence 一致,其他條件都一樣時,金屬傾向於溶解較高價數的

EX.Cu-Ni

間隙型

當金屬 APF 越高,越不易出現(但注意,FCC 雖然 APF 比 BCC 高,但他的隔隙位置較大!!約 1.4 倍,見後面的圖)

雜質原子需要很小,但還是通常會大於間隙,所以間隙型濃度很小(<10%),且會引入 lattice strain

EX.C 加入鐵(912~1394 的 FCC 鐵)中,型成間隙固溶體,C 的最大濃度約 2% 若為 BCC,僅能溶 0.025%

*濃度換算考前再喵一下

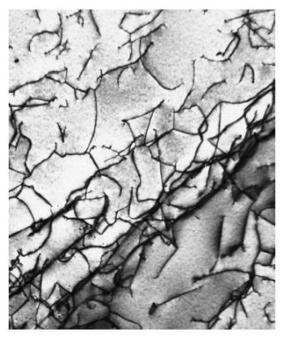
差排

一維線性缺陷,圍繞差排的原子 misaligned

差排線→額外半平面原子的端點連成的線

Burger vector→lattice distortion 的大小和方向,且指向最密堆積方向,大小等於 interatomic spacing.

Edge 和 b 垂直;Screw 和 b 平行



TEM 常用來觀察差排 這張圖的暗線是差排!

幾乎所有 crystalline metal 都有差排,因為凝固.塑性變型.快速冷卻的熱應力

介面缺陷 INTERFACIAL DEFECTS→2D,分開不同晶體結構或結晶方向

外表面→未與鄰近原子形成最大數的鍵結→沒被滿足的表面原子使的有較高的表面能→為降低此能量,材料會傾向於降低總表面積

所有的 external surface 都是缺陷!!

晶界

多晶材料中,2 不同結晶方性的 grain 或 crystal 的界線,約有 2~5 個原子直徑的 寬度,因原子不匹配,晶界中的原子堆積密度比晶粒中低。有些原子處於高應力, 導致提高介面能量。

→較高能量、較鬆散,有助於<u>成核或析出</u>,且擴散在這區域較快 常溫下,因塑性變形的限制,差排和晶界難移動,可強化金屬,但較<u>高溫度下</u>, 會晶界滑動,成為做脆弱的部分。

依 degrees of crystallographic misalignment → 小角度&大角度

小角度晶界

Edge 差排→tilt boundary(右圖) -->通常小於 10 度! Screw 差排→twist boundary

也會強化材料

隨著小角度晶界(tilt 和 twist)的差排密度增加,相差角度也增加,形成大角度。

大角度晶界→規則性較少,晶界能是角度的函數,角度越大 →晶界能越高→晶界能態高,雜質在此偏析 *大晶粒→總面績小→總界面能小

(高溫晶粒成長以降低晶界能)

即使晶界這種無序排列,和缺乏規則鍵結,多晶材料還是 很強壯,邊界之間的 cohesive force 存在,且同材料,<u>單晶和</u> 多晶的密度是差不多相同的!! 為啥晶界很好用光學顯微鏡觀察?

因為晶界相對於晶粒好 etch,會產生小 groove,透過顯微鏡可觀察到 dark lines

Twin Boundaries → a special type of grain boundary across which there is a specific mirror lattice symmetry

這些晶界間的區域→twin

因機械剪力→mechanical twins→BCC.HCP

因退火(再結晶過程)→annealing twins→FCC

Twinning 發生在特定的結晶平面和方向,取決於晶體結構!



這張多晶 brass 試片照片 可觀察出退火雙晶 (就算看不出來,考試也要寫看得出來)

Stacking fault(piling-up fault)→FCC→ABCABCABC,最密堆積平面中斷時,也會強化材料。

*疊差、雙晶、小角度晶界都有局部晶格畸變,都可以強化材料

Phase Boundary → 發生於多相材料中,物化特性有突然的變化

Domain wall→鐵磁和亞鐵磁材料中,分開不同磁化方向

以上面缺陷都伴隨著界面能!大小取決於邊界形式和材料,通常,External surface 有最大的晶界能,而 Domain wall 最小

體缺陷 Bulk Defects→ pores, cracks, foreign inclusions, and other phases,通常由製造期間引入

原子振動也可算是一種缺陷,室溫下,振動頻率約 $\underline{10^{13}}$ 振幅是<u>奈米的幾千倍</u> **顯微技術**

Optical	1.optical+illumination systems	
Microscopy	2.reflecting mode	
	3.金屬首先使用,所以又稱 metallographic	
	4.研磨試片→etching	
	5. an etchant is often chosen that produces a different texture for each phase	
	6.倍率上限約 2000	
Electron	成像是由電子束,根據量子力學,速度和波長成反比,加速使電子波長變短,	
Microscopy	約 0.003nm→短波長造成高倍率,再用 magnetic lenses 成像	
	TEM→藉由電子通過試片,試片要薄→可觀察差排,倍率約 10 ⁶	
	SEM→收即電子的反射束→需電導體,非導體要鍍金屬層→用在材料特性研	
	究,倍率可到 5*10⁴	
Scanning	1.倍率高達 10°→宣告了奈米時代的來臨!!	

Probe 2.三度空間影像 Microscopy 3.可用在各種環境

SPM STM(scanning tunneling)-->需用再高真空、且須用於可導電材料

(探針) AFM(atom force)-->探針結合懸臂樑,凡德瓦力,用雷射和光偵測器監測

可用在所有材料!!

非接觸型-->短距離排斥力;接觸型-->長距離吸引

倍率 SPM>TEM>SEM>OM; STM、AFM 倍率差不多

晶粒大小決定

intercept method

- 1.規定一長度→Ⅰ
- 2.取得多次交截數量,算平均→n
- 3.平均交截長度 L=I/n
- 4.直徑=L/倍率(想,我直徑一定比圖看到的小很多嘛!)

ASTM 標準

 $N = 2^{n-1}$ N:100X 下,每平方英吋的平均晶粒數 n:晶粒號碼

$$n = \frac{\log N}{\log 2} + 1$$

n越大→N越大→固定面積看到的晶粒數多→晶粒越小

Coarse-grained 初	n<3
Medium-grained	4 <n<6< td=""></n<6<>
Fine-grained	7 <n<9< td=""></n<9<>
Ultrafine-grained 超細	n>10

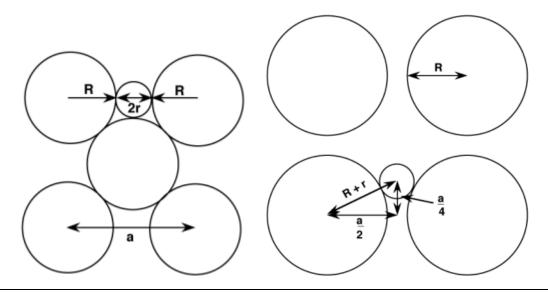
(b) At magnifications other than $100\times$, use of the following modified form of Equation 4.16 is necessary:

$$N_M \left(\frac{M}{100}\right)^2 = 2^{n-1} \tag{4.17}$$

改用 M 倍率!!,等式右邊不變,因為晶粒號碼是固定的!!改用倍數越大,可看到的晶粒數越小!!!

FCC 格隙位置

BCC 格隙位置



對 FCC.BCC 而言,burger vector 可以表成

b = (a/2)[hkl] 其中[hkl]是最大線原子密度方向!!

For FCC

BCC

Simple Cubic

$$\mathbf{b} = \frac{a}{2} [110] \quad \mathbf{b} = \frac{a}{2} [111] \quad \mathbf{b} = \frac{a}{2} [100]$$

$$\mathbf{b} = \frac{a}{2} [111]$$

$$\mathbf{b} = \frac{a}{2}[100]$$

大小:

$$b = \frac{a}{2} \sqrt{h^2 + k^2 + l^2}$$

物冶部分補充

- ※要會推導平衡空位濃度
- ※引進非平衡空位濃度的方法
- 1.quench
- 2.形成介金屬化合物
- 3.高能量粒子衝擊
- 4.差排交互作用
- 5.金屬氧化

※理論差排

應力週期性

剪移所需的應力→約 0.5G

實際上→約 10⁻⁵G

差很多,實際上並非剛體般相對滑移,而是從局部,擴展至面。

※差排

滑移與未滑移間→差排線

Edge:布格與差排線垂直→內積等於 0,滑移面唯一

Screw:布格與差排線平行→外機等於 0,滑移面無限多個

※差排應變能正比於布格的平方

※晶界五種自由度
Tilt boundary→2個
Twist boundary→1個
Tilt +Twist→2個

*

小角度晶界用差排模型描述 Sin(θ /2)=b/2h

大角度晶界無法用差排模型

ightarrow $ext{the Coincidence site boundary}
ightarrow$ Coincidence site lattice, CSL

其定義的Σ→原子在共同位置機率大小

Σ 越小→原子排列越規則→能量越低越穩定